

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 3 部門第 1 区分

【発行日】平成24年11月15日 (2012.11.15)

【公開番号】特開2012-188321(P2012-188321A)

【公開日】平成24年10月4日 (2012.10.4)

【年通号数】公開・登録公報2012-040

【出願番号】特願2011-53865(P2011-53865)

【国際特許分類】

C 0 1 B 3/26 (2006.01)

C 0 1 B 31/02 (2006.01)

C 0 1 B 31/18 (2006.01)

C 0 7 C 29/151 (2006.01)

C 0 7 C 31/04 (2006.01)

【F I】

C 0 1 B 3/26

C 0 1 B 31/02 1 0 1 F

C 0 1 B 31/18 A

C 0 7 C 29/151

C 0 7 C 31/04

【手続補正書】

【提出日】平成24年7月24日 (2012.7.24)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項 1 1

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 1 1】

前記回収工程で触媒とともに回収されたナノカーบอนを微粉化した後、高純度ナノカーボンと、前記触媒を高濃度に含有するナノカーボンとを比重選別、またはノおよび磁気選別し、前記触媒を高濃度に含有する前記ナノカーบอนを優先的に前記二酸化炭素還元工程に供することを特徴とする請求項 1 ~ 1 0 のいずれかに記載の合成ガスとナノカーบอนの製造方法。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項 1 5

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 1 5】

前記低級炭化水素分解反応装置で生成されたナノカーบอนを回収するナノカーボン回収部と、該ナノカーボン回収部で回収した後のナノカーบอนを前記二酸化炭素還元反応装置に移送するナノカーボン移送路を備えることを特徴とする請求項 1 2 ~ 1 4 のいずれかに記載の合成ガスとナノカーบอนの製造システム。

【手続補正 3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 0 6

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 0 6】

【補正の内容】

[illegible]

【図 3】

